

超高真空金屬與金屬氧化物奈米級薄膜濺鍍系統

- 現有標準製程

可沉積薄膜: Co、Pt、Ru、Ta、W、CoFeB₂₅、CoFeB₂₀、CoFe、Mo、Mg、MgO，各層厚度限制3 Å~200 Å